



Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche

Université de Franche-Comté
Maison de l'Université
1, Rue Goudimel
25030 Besançon
Tel : 03.81.66.59.02
Service.marches@univ-fcomte.fr

MARCHÉ PUBLIC

APPEL D'OFFRES OUVERT

CCAP n °19.002 du 14 mars 2019

Système de collage multi-wafer

Annexe n°3

Récapitulatif des Prestations Supplémentaires Eventuelles

Il est demandé que la machine soit capable d'effectuer d'autres procédés du collage, éventuellement après installation de composants additionnels. Le tableau suivant présente les options facultatives qui peuvent être chiffrées par le candidat.

	Description	Paramètres demandés
Option facultative 1	Collage de petits substrats	<ul style="list-style-type: none"> • Wafers 3" ($\phi=76\text{mm}$) • Petit substrats non standards de forme rectangulaire ou carrée ex. $10 \times 10\text{mm}^2$ ou $20 \times 20\text{mm}^2$ (les dimensions sont à confirmer)
Option facultative 2	Traitement plasma « in-situ » afin d'activer la surface pour diminuer la température de la soudure.	<ul style="list-style-type: none"> • Plasma de gaz process (N_2, O_2, Ar) • Traitement automatisé, contrôlé par logicielle du bonder <p>L'offre devra spécifier tous les éléments supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du système.</p>
Option facultative 3	Collage anodique dans une configuration "Triple stack"	<ul style="list-style-type: none"> • Collage de 3 wafers en une seule étape de collage anodique • Pour wafer 4" et 6"
Option facultative 4	Exposition aux UV "in-situ" pour un collage adhésif de type « UV-cure »	L'offre devra spécifier tous les éléments supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du système.
Option facultative 5	Alignement « in-situ » IR à travers des substrats opaques (collage Si-Si).	<p>L'alignement Si-Si, une large gamme de résistivité (ex. $0.01 - 1000 \Omega\text{cm}$).</p> <p>L'offre devra spécifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La précision d'alignement IR • L'épaisseur maximale d'empilement possible à aligner
Option facultative 6	Pièces de rechange (back-up) pour le système de pompage.	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe primaire (sèche) • Pompe secondaire (turbo moléculaire)
Option facultative 7	Microscope macro zoom	<ul style="list-style-type: none"> • Inspection rapide des wafers • Equipé d'un écran LCD HD et d'une caméra HD avec un objective Zoom • Grand espace de travail
Option facultative 8	Contrat de maintenance hors de la période de garantie	<ul style="list-style-type: none"> • Contrat de maintenance • Support de développement des procédés

A..... le,

Lu et approuvé

L'entreprise, (cachet et signature)